

日本学術振興会「結晶加工と評価技術」第145委員会
第111回委員総会議事次第

日時 2019年8月30日（金） 17:30～17:50
場所 明治大学駿河台キャンパス 大学会館第3、第4会議室

議題 1. 事務連絡
2. 委員動静・幹事構成について
3. 2018年度の決算と2019年度の予算報告について
4. 2019年度の研究会企画について
5. 2020年ハワイシンポジウムについて
6. その他

配付資料 1. 第9期委員名簿
2. 2018年度決算報告と2019年度予算報告

【今年度定例研究会予定】

(1) 第163回研究会「窒化物半導体中の欠陥評価の最近の進展（161と合同）」

期日、場所：2019.5月8日
明治大学紫紺館4階会議室
世話人：酒井、三宅、上田

(2) 第164回研究会「放射線を用いた先端計測技術：

—見えない光でもものを見る、検出器開発から応用研究まで—（委員総会開催）
期日、場所：2019年8月30日
明治大学駿河台キャンパス 大学会館第3、4会議室
世話人：志村、表、廣沢

(3) 第165回研究会「SiCの現状と問題点そして将来の展開等」

期日、場所：2019年11月13日
関西学院会館2Fレセプションホール（風の間）
世話人：大谷、西澤

(4) 第166回研究会「結晶薄化技術（仮題）」

期日、場所：2019年12月12日
明治大学駿河台キャンパス
世話人：佐野、閻

(5) 第167回研究会「シリコンフォトニクス関連（仮題）」

期日、場所：2020年1～2月開催を念頭に、未定
世話人：志村

【来年度主催国際会議予定】

(1) 会議名：2020年度ハワイシンポジウム

第8回 International Symposium on Advanced Science and Technology of Silicon Materials
期日、場所：2020年11月15日-19日
実行委員会委員長：末岡、プログラム委員長、西澤
Kona, Sheraton Hotel, Hawaii

(2) 会議名：DRIP-XIX

期日，場所：の開催予定は2021年度（10月頃）
実行委員会委員長：土田、関口
横浜かつくば

第145委員会のHP <http://www.riam.kyushu-u.ac.jp/nano/gakushin145/>